# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-17817

(43)公開日 平成5年(1993)1月26日

(51)Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 2 1 D	1/63		9269-4K		
	1/18	G	9269-4K		
		J	9269-4K		
	1/74	K	9269-4K		

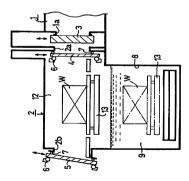
	審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)
特顯平3-170929	(71)出願人 000167200 光洋リンドバーグ株式会社
平成3年(1991)7月11日	奈良県天理市嘉幡町229番地
	(72)発明者 奥田 元茂 天理市嘉幡町229番地 光洋リンドパーグ 株式会社内
	(74)代理人 弁理士 岸本 瑛之助 (外3名)

# (54) 【発明の名称 】 焼入装置

# (57)【要約】

【構成】 密閉構造とされた焼入室(2) 内に焼入冷却液 槽(8) を設ける。焼入室(2) に、焼入室(2) 内の圧力を 制御する圧力制御装置を設ける。

【効果】 冷却剤の種類を変えることなく、冷却曲線を 任意に変化させることができる。したがって、被処理物 が多品種にわたった場合にも、各被処理物に、これに応 じた品質を付与することができる。



#### 【特許請求の節用】

【請求項1】 密閉構造とされた焼入室内に焼入冷却液 憤が設けられ、焼入室に、焼入室内の圧力を制御する圧 力制御装置が設けられている焼入装置。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、金属の熱処理装置の 加熱装置に連続して設置される焼入装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術と発明の解決すべき課題】従来、熱処理を 10 施される被処理物が、多品様に力たる場合、各被処理物が同村に、形状等や、各被処理物に要求される映き、金属組織および歪み最等の品質に応じて、種類や温度の異なる彼状冷却利の入れられた焼入冷却依槽を複数 用意と しておき、各体処理物に応じた冷却剤を用いて焼入れを行っていた。

【0003】しかしながら、従来の方法では設備コスト および検索コストが高くなるとともに、大きな設置スペ ースが必要になるという問題があった。しかも、全自動 ラインの場合、搬送経路が複雑になるという問題があっ 20 た

【0004】さらに、従来の方法によっても、被処理物 の焼入後の状態は、冷却剤の種類により決まるので、硬 さ、金属組織および歪み量等の品質を微妙に認節するこ とができないという問題があった。すなわち、これらの 品質は、冷却時間と温度との関係を表す冷却曲線により 決定される。たとえば図3に実線(A)で示すように、冷 却の第1段階(X) では、冷却剤の蒸気膜が被処理物の全 面を覆うので冷却速度は遅く、ついで所定の特性温度に なると第2段階(Y) に移行して冷却速度は急激に大きく なり、その後対流により冷却が進む第3段階(Z) に移行 して冷却速度は最も遅くなる (Cの部分)。そして、各 段階の時間、冷却速度、および開始または終了温度を変 更することによって上記品質が変わる。ところが、冷却 剤の種類によって冷却曲線は決まるので、硬さ、金属組 織および歪み量等の品質を微妙に調節することができな いそこで、この問題を解決するために、①冷却剤を撹拌 または噴射により流動させたり、②前もって冷却剤の温 度を変更したり、③水溶性冷却剤を用いた場合にはその 設度を変化させたりすることが考えられている。

【0005】しかしながら、①の方法では、冷封剤の均一な流速を得られず、被処理物の恋みが大きくなるという問題がある。②の方法では、温度の変更のために長時間を要するとともに硬化の程度に制限を受けるという問題がある。③の方法では、冷封剤の種類を変更するのと同じで、各被処理物ごとに対応できないという問題がある。

【0006】この発明の目的は、上記問題を解決した焼 入装置を提供することにある。

# [0007]

【課題を解決するための手段】この発明による焼入装置 は、密閉構造とされた焼入室内に焼入冷却液槽が設けら れ、焼入室に、焼入室内の圧力を制御する圧力制御装置 が設けられているものである。

#### [8000]

【作用】焼入時に、焼入室内の圧力を変動させると、冷 却剤の種類を変えることなく、上配冷却曲線を任意に変 化させることができる。

### [00009]

【実施例】以下、この発明の実施例を、図面を参照して 3월明する

【0010】図1および図2は、この発明による焼入装置の1実施例を示す。

【0011】図 および図2において、焼入装置は、加 熱装置の加熱室(1)に連なって設けられかつ密閉構造と された焼入室(2)を備えている。加熱室(1)の出口(1 a)、焼入室(2)の入口(2a)および同出口(2b)にはそれぞ れ可動扉(3)(4)(5)が設けられている。焼入室(2)の入 口(2a)および同出口(2b)に設けられた可動扉(4)(5)は、 閉鎖時にそれぞれロック装置(6)により入口(2a)および 出口(2b)の周縁部に押し付けられるようになっており、 このとき入口(2a)および出口(2b)の周縁部との間に配置 されたのリング(7)によって焼入室(2)が密閉構造とさ れる。

【0012】焼入室(2) 内の下部には焼入冷却液槽(8) が設けられており、この中に液状冷却刺(9) が入れられている。焼入冷却液槽(8) には、冷却刺(9) を流動させる撹拌機(11)が配置されている。また、図示は省略したが、焼入冷却液槽(8) には冷却刺(9) の温度調節装置が設けられている。旋入室(2) 内には、上部空間(12)と焼入冷却液槽(8) 内との間で上下動するエレベータ(13)が設けられている。

【0013】焼入室(2)には、焼入室(2)の上部空間(12)内の圧力を調整する圧力調整装置が設けられている。 圧力調整装置は、図1に示すように、焼入室(2)の上部 空間(12)内の圧力を検知する圧力センサ(15)と、焼入室 (2)にアクチュエータ付き排気弁(16)を介して接続された だ真空ボンブ(17)と、同じく焼入室(2)にアクチュエー 夕付き不活性ガス供給弁(18)を介して接続された高圧不 活性ガスタンク(19)と、アクチュエータ付きリーク弁(2 り)とを備えている。圧力センサ(15)、排気弁(16)、不活 性ガス保給弁(18)およびリーク弁(21)は、プログラムコ ントローラ(22)に接続されている。プログラムコントローラ(22)には、予め小型の実験装置で求められた被処理 物(2)の要求品質を満たす冷却曲線を得るための圧力条 作が入力されている。なお、焼入室(2)には安全弁(23) が設けられている。

【0014】このような構成において、加熱室(1)の出口(la)および焼入室(2)の入口(2a)の可動騒(3)(4)が開かれ、加熱室(1)において加熱された彼処理物(%)が焼

入奎(2) の上部空間(12)内に短入され、上昇位置にある エレベータ(13)上に歳せられる。そして、可動庫(3)(4) が閉められ、焼入室(2)内が密閉状態とされる。つい で、エレベータ(13)が下降し、接処理物(6)が冷却剤 (9)中に設づされる。焼入室(2)内が密閉状態とされた 後、接処理物(7)が冷却利(9)中に設づされる前または 後に、圧力調整装置により焼入室(2)内が所定の圧力と され、その圧力で所定時間保持される。その後、プログ ラムコントローラ(22)に予め入力されていた条件に基い で、排気条(16)、不活性ガス供給弁(18)およびリーク弁 (21)が開閉されて加圧および/または減圧され、焼入室 (2)内の圧力が変化させられる。冷却が終了すると、エ レベータ(13)が上昇し、出口(2b)の可動扉(5)が開かれ で搬出される。

3

【0015】上記において、焼入室(2) 内が常圧(1bar) のとき、被処理物(5) の冷却曲線は図3に実線(A)で示すようになる。焼入室(2) 内を加圧していくと、第1段階(X) の時間が短くなり、しかも第3段階(2) の冷却速度が小さくなる。2 bar および5 bar のときの冷却曲線を実線(B) および(C) で示すようになる。逆に、焼入室(2) 内を減圧していくと、第1段階(X) の時間が長くなり、しかも第3段階(Z) の時間が長くなり、しかも第3段階(Z) の時間が長くなり、しかも第3段階(Z) の時間が長くなり、しかも第3段階(Z) の時間が長くなり、しかも第3段階(Z) の時間が長くなり、しかも第3段階(Z) の時間が長くなり、しかも第3段階(Z) の特別重度が大きくなる。0.5 bar およびの、1 barのときの冷却曲線を実線(D) および(E)で示すようになる。そして、冷却が終了するまでに焼入室(Z) 内の圧力を、加圧状態と減圧状態とが適当に組合さるように測整することによって、冷却曲線を図3に実線のハッチングを付した部分で任意に変化させること

が可能になる。したがって、被処理物(!!) に要求される 品質を付与することができる。

【0016】上記実施例において、焼入室(2)と真空ホンフ(17)とを接続する管に、排気弁(16)をまたがるようにバイバス管を接続しておき、このバイパス管に排気弁(16)よりも容量の小さいアクチュエータ付き弁を設けておくのがよい。また、焼入室(2)と高圧不活性ガスタンク(19)とを接続する管に、供給弁(18)をまたがるように、バイバス管を接続しておき、このバイパス管を接続しておき、このバイパス管を接続しておき、このパイパス管に供給弁(18)よりも容録の小さいアクチュエータ付き弁を設けておくのがよい。これらの弁もプログラムコントローラ(22)に接続しておく。こうすれば、焼入室(2)内圧力の微調整が可能となる。

#### [0017]

【発明の効果】この発明の焼入装置によれば、冷却剤の 種類を変えることなく、上記冷却曲線を任意に変化させ ることができる。したがって、被処理物が多品種にわた った場合にも、各被処理物に、これに応じた品質を付与 することができる。

### 。 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の焼入装置の実施例を示す概略正面図 である。

【図2】この発明の焼入装置の実施例を示す概略側面図 である

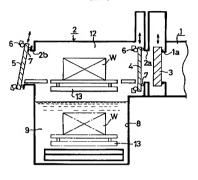
【図3】焼入室内の圧力を変化させた場合の冷却曲線を 示すグラフである。

【符号の説明】 2 焼入室

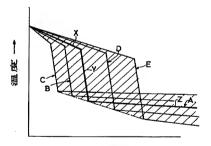
焼入室
焼入冷却液槽

【図1】





# 【図3】



時間→